

秋田県産業技術センター

施設・設備リスト

2023.04.01 企画事業部

秋田県産業技術センター 施設・設備利用のご案内

秋田県産業技術センターでは、試験研究、技術相談・指導、技術者育成、研究会活動、研修会・講習会の開催、技術情報の提供などの業務を行っております。

当センターは、県内企業をはじめ外部の方に施設や設備機器を次のとおり開放しております。

(1)利用者

どなたでもご利用いただけます。

(2)利用対象施設、設備機器および使用料

施設及び設備使用料に記載しているとおりです。

(3)利用日時

原則として、当センターの休業日を除く午前9時から午後5時までです。

(4)利用・申し込み方法

あらかじめホームページお問い合わせフォーム、Eメール、又は電話等で、対象設備、利用日時等をご連絡のうえ、当日まで申請手続きをお願いします。

使用が可能な場合は、許可証を交付します。

(5)使用方法

設備機器の使用方法については、必要に応じて当センター職員が指導します。

(6)支払い方法

当センターで発行する納入通知書により、指定金融機関に納付ください。

(7)ご利用にあたっての遵守事項

- ①会議室等の使用に際しての机、椅子の準備及び復旧は、使用者の責任において行ってください。
- ②茶器は無償で貸し出しますが、消耗品はお持込いただき、後片付けは使用者の責任において行ってください。
- ③敷地内(駐車場・駐車中のお車の中を含む)は、全面禁煙です。
- ④設備機器のご利用にあたっては、原則として危険物及び有害物質の持ち込みを禁止します。
- ⑤当センターの施設及び設備機器をき損した場合は、直ちに届出願います。
故意又は過失によると認められる場合には、損害賠償の責任が生じますので、ご注意ください。

【申し込み・照会先】

秋田県産業技術センター

〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4番11

TEL 018-862-3414 (自動音声でご案内いたします)

FAX 018-865-3949

Home page <https://www.aitc.pref.akita.jp>

E-mail soudanshitu@aitc.pref.akita.jp

施設使用料および設備使用料

1. 開放研究室

(1)本館

区 分	面積[m ²]	室数	使用料(円／月)
開放研究室 A	59	1	71,130
開放研究室 B	46	6	67,890
開放研究室 C	40	2	45,260

(2)高度技術研究館

区 分	面積[m ²]	室数	使用料(円／月)
高機能開放研究室	61.44	5	99, 630

2. 講堂・研修室・会議室・展示室

(1)本館

区 分	収容人数[人]	使用料(円)		
		9:00～12:00	13:00～17:00	9:00～17:00
講 堂	100	3,600	4,800	8,400
研修室 B	20	1,110	1,480	2,590
展示室	1,360(1 日)			

以下の付属備品は無料で利用できます。施設の使用申請の時に合わせてお申し込みください。

- ・ 液晶プロジェクタ、スクリーン、ホワイトボード、ワイヤレスマイク

(2)高度技術研究館

区 分	収容人数[人]	使用料(円)		
		9:00～12:00	13:00～17:00	9:00～17:00
視聴覚研修室	100	9,900	13,200	23,100
研修室 A	24	3,600	4,800	8,400

付属設備

区 分		使用単位	使用料(円)
視聴覚研修室	映像装置	一式 1 時間 につき	2,150
	同時通訳装置		1,620
研修室 A	拡声装置		530

3. 設備機器

次頁以降の一覧表をご参照ください。

(注1) 使用時間が1時間未満である時、または当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料となります。

(注2) 付属装置の設備使用料が追加される場合があります。

秋田県産業技術センター設備機器一覧

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
1	高周波3次元電磁界シュミレータ	アンソフト・ジャパン(株)	HFSSV・10・0	H17	970	熊谷
2	三次元電磁界最適化設計ツール	アンソフト・ジャパン(株)	Optimetrics	H18	110	熊谷
3	電磁界解析用ワークステーション	DELL	PrecisionT5400	H20	110	熊谷
4	PC制御画像認識塗布システム	武蔵エンジニアリング(株)	SHOTMASTER SM300DSS-3A+IMAGE MASTER 350PCSmart	H28	220	熊谷
5	レーザーカッター	エピログ	Epilog Mini 24	H29	270	熊谷
6	非接触ジェットディスペンサー	武蔵エンジニアリング	AeroJet	R02	100	熊谷
7	低雑音振幅器	MITEQ	NSP2000-P	H18	110	丹
8	ローパスフィルタ	(株)エヌエフ回路設計ブロック	NF 3660	H04	440	丹
9	フォトレシーバ	NewFocus	1544-B-50	H22	110	丹
10	ロックインアンプ	Anfatec Instruments	eLockIn205/2	H25	100	丹
11	電流アナライザ	キーサイト・テクノロジー(株)	CX3324A	R04	3,500	丹
12	精密騒音計	リオン(株)	NL-52EXK	H25	100	内田(勝)
13	総合型金属顕微鏡	オリンパス(株)	DSX500,DSX100	H25	540	内田(富)
14	超高精度三次元測定器	Panasonic(株)	UA3P-300	H20	2,930	久住
15	非接触式表面性状評価装置	キヤノン	NewView6300	H19	1,150	久住
16	非接触式フィゾー干渉計	キヤノン	GPI XP/D	H19	580	久住
17	4インチ光学原器	ZYGO(株)	TS f/0.65, f/1.5, f/3.3	H21	300	久住
18	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	ZYGO(株)	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	H23	140	久住
19	CNC3次元測定機	カールツァイス(株)	PRISMO 5 HTG-S	H07	470	加藤
20	真円度測定機	ランクテラーホブソン(株)	タリロンド262型	H08	110	加藤
21	CNC三次元測定機用データ処理装置	(株)東京精密	Calypsoシステム	H18	850	加藤
22	超高倍率3次元複合顕微鏡	島津製作所	ナノサーチ顕微鏡SFT-3500ほか	H17	1,680	加藤
23	非接触形状測定顕微鏡	(株)キーエンス	VK-9500	H15	1,030	加藤
24	表面粗さ測定機	(株)東京精密	サーフコム3000A-3DF-DX-S	H13	120	加藤
25	高精度CNC画像測定機	(株)ニコンインステック	NEXIV VMZ-R6555	H27	800	加藤
26	デジタルマイクロスコブ	オリンパス	DSX1000	R04	700	黒沢(憲)
27	3D鋳型積層造形装置	シーメット	SCM-10	H27	4,950	内田(富)
28	3次元X線CTシステム	(株)東芝	TOSCANER-32300μFD	H28	2,850	内田(富)
29	ハイエンド3Dプリンターシステム	ストラタシス	J750	R01	8,850	内田(富)
30	3D形状計測システム	東京貿易テクノシステム	VMC7000M	R02	3,000	黒沢(憲)
31	再資源化焼結炉	アドバンテック東洋(株)	KS-1703型	H07	160	遠田
32	管状炉	(株)タナカテック	MPH-6VGS	H15	520	遠田
33	炭化賦活炉	(株)ウェーブ21	炭化賦活炉 T-2000L	H16	1,210	遠田
34	ナノバブル評価装置	マイクロトラック・ベル(株)	ZetaView-PMX100SP	H29	410	遠田

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
35	プラスチックノッチ加工機	東洋精機製作所	A-4	R04	170	野辺
36	振動試験機	エミック(株)	F-03000BM/FA	H16	1,210	丹
37	空圧落下衝撃試験装置	ボクスイ・ブラウン(株)	SM-110-MP型	H03	110	伊藤(亮)
38	衝撃波記録解析装置	Lansmont	Test Partner TP3.0-USB	H26	100	伊藤(亮)
39	絶縁耐圧試験器	日置電機(株)	3159	H17	110	伊藤(亮)
40	光テストシステム装置	横河電機	AQ2200	H17	710	佐々木(信)
41	ベクトルシグナルジェネレータ	アジレント・テクノロジー(株)	V2920A	H21	310	佐々木(信)
42	ミックスドシグナルオシロスコープ	日本テクトロニクス(株)	MSO4104	H20	110	佐々木(信)
43	ソフトウェア品質評価試験システム	(株)ハートランドデータ	DT10 STD Value IVセット	H26	260	佐々木(信)
44	差動プローブセット	ソニー・テクトロニクス(株)	P6330・P5210・TCP202S	H14	110	佐々木(大)
45	計測制御ソフトウェア開発システム	日本ナショナルインスツルメンツ	LabVIEW 2010プロフェッショナル開発システム	H23	110	佐々木(大)
46	熱特性測定装置	NETZSCH	LFA457-A21 MicroFlash	H21	1,210	菅原
47	電気伝導率・熱電率測定装置	真空理工(株)	ZEN/PEM-1型	H09	1,410	関根
48	高温動弾性率測定装置	東芝タンガロイ(株)	UMS-HL	H10	3,410	関根
49	超硬製転動ミル用容器	(株)伊藤製作所		H20	110	関根
50	ナノインデント	米国Hysitron社	Model Triboscope他	H14	3,040	関根
51	熱膨張測定装置	理学電機(株)	Thermo Plus 2	H15	470	関根
52	電界放射走査電子顕微鏡	日立製作所	S-4500	H08	620	菅原
53	S-4500用オートステージ	(株)日立製作所	S-8432型	H12	110	菅原
54	電子プローブマイクロアナライザー	日本電子(株)	JXA-8200ほか	H13	1,680	菅原
55	圧縮成形機	東洋精機(株)	試験用加硫プレス 30ton f	S58	280	工藤(素)
56	真空加熱プレス装置	井元製作所	1824型	H19	110	工藤(素)
57	3D射出成形シミュレーションシステム	富士通(株)	CELSIUS W480-NTM	H23	1,150	工藤(素)
58	示差走査熱量計	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	X-DSC7000	H23	630	工藤(素)
59	プラスチック万能材料試験機(CFRP用)	インストロン(株)	5967型	H24	940	工藤(素)
60	メルトインテグサ	(株)東洋精機製作所	型式G-01	H25	250	工藤(素)
61	プラスチック自動比重計	東洋精機製作所	DSG-1	H28	100	野辺
62	デジタル硬度計	テクロック	GSD-1	H29	100	野辺
63	自動プラスチック衝撃試験機	東洋精機製作所	IT	R04	250	野辺
64	電子天秤	ザルトリウス(株)	MC210S	H10	110	工藤(素)
65	電子天秤	ザルトリウス(株)	A200S	H10	100	工藤(素)
66	ハイエンド3次元CAD/CAMシステム	伊藤忠テクノサイエンス	Pro/ENGINEER Wildfire 4	H10	110	内田(富)
67	3次元CADシステム	DASSAULT SYSTEMS	Solidworks	H28	500	内田(富)
68	鋳造CAEシステム	クオリカ	JSCAST	H29	580	内田(富)
69	色彩色差計	日本電色工業(株)	SQ-2000	H12	290	工藤(素)
70	フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光(株)	IRT-7000	H21	840	工藤(素)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
71	粘弾性測定装置	(株)アントンパール・ジャパン	MCR302	H26	1,120	工藤(素)
72	低高抵抗率計システム	(株)三菱アナリック	ロレスタMCP-T610,ハイレスタMCP-HT800	H26	210	野辺
73	熱分析装置	(株)リガク	TG-DTA8122 / TMA8311(-S) / TMA8311(-H) / DSC8271 / DSCvesta	R02	1,120	関根
74	フーリエ変換赤外分光光度計	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)	Nicolet iS50/iN10MX	R04	1,240	阿部
75	小型電気炉	(株)セイシン企業	PART-3	H02	260	菅原
76	低温恒温水槽	小松エレクトロニクス	DW-621	H08	110	菅原
77	電動式塗工機	(株)小平製作所	YOA-B型	H18	110	菅原
78	動的ひずみ解析装置	(株)共和電業	EDX-1500A-16AC	H10	110	内田(富)
79	セミビッカース硬度計	マツザワ	PVT-7S	H21	430	関根
80	マイクロビッカース硬度計	(株)マツザワ	AMT-X7FS-B	H28	270	関根
81	X線回折装置	(株)リガク	RINT-2500	H09	720	菅原
82	原子吸光分光分析装置	日本ジャーレルアッシュ(株)	SOLAAR M-6	H15	1,100	工藤(素)
83	酸素・窒素分析装置	(株)堀場製作所	EMGA-620W/C	H13	1,360	工藤(素)
84	炭素・硫黄分析装置	LECO社	CS-200型	H13	890	工藤(素)
85	高周波プラズマ発光分光分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)	iCAP6300 Duo	H23	3,670	工藤(素)
86	蒸留水製造装置	アドバンテック東洋(株)	RFD240ND	R04	100	工藤(素)
87	スクラッチ試験機	新東科学(株)	TYPE.22H	H06	400	瀧田
88	微小硬さ試験機	(株)フィッシャー・インストルメンツ	H-100	H14	490	瀧田
89	X線残留応力測定装置	パルステック工業(株)	m-X360s	R02	750	瀧田
90	X線応力測定装置	(株)マックサイエンス	MXP3AHP	H07	1,730	黒沢(憲)
91	低温灰化装置	ヤマト科学(株)	PDC-210	H15	680	工藤(素)
92	電気マッフル炉	アドバンテック東洋(株)	FUS612Pa	H15	360	工藤(素)
93	ドラフトチャンパー	(株)ダルトン	DFB11-DFC14,DFD31	H27	730	工藤(素)
94	精密旋盤	池具鉄工	D-20型	S47	260	加藤
95	ドリル研削盤	(株)藤田製作所	DG36A形	S55	220	加藤
96	圧電型切削動力計	日本キスラー(株)	9257B	H02	680	加藤
97	コンターマシン	アマダ	V-400	S47	110	加藤
98	直立ボール盤	(株)吉田製作所	YUD600	S47	110	加藤
99	卓上ボール盤	吉田鉄工所	YBD-420B	S43	110	加藤
100	超精密成形形状研削盤	(株)ナガセインテグレックス	SGC-630S4AK-Pcnc	H22	3,670	加藤
101	油圧式強力高速弓鋸盤	津根マシナール(株)	PSB-350U	H12	280	加藤
102	ワイヤーカット放電加工機	(株)ソディック	AQ360L	H18	1,010	加藤
103	5軸制御立形マシニングセンタ	オークマ(株)	MU-400VⅡ型	H26	2,740	加藤
104	NCフライス盤	(株)山崎技研	F-352	R03	1,280	加藤

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
105	細穴放電加工装置	(株)ソディック	K1C	R04	730	関根
106	プラスチック粉碎機	ホーライ	VC3-360	H12	240	工藤(素)
107	エコーチップ硬さ試験機	プロセク社(スイス)	D型	S60	130	内田(富)
108	鋳型焼成雰囲気炉	日新化熱工業(株)	EBS-9(改)	H10	1,310	内田(富)
109	チタン用精密鋳造機	吉田キャスト	YSE-100	H28	1,270	内田(富)
110	複合サイクル腐食試験機	スガ試験機	CYP-90	H20	290	菅原
111	プレス付真空熱処理装置	東京真空(株)	PRESS-VAC-2	H03	580	瀧田
112	レーザ加工装置	レーザライン	LDM3000-60	H29	1,900	瀧田
113	マイクロフォーカスX線装置	日本フィリップス(株)	HOMX-161	H05	1,830	黒沢(憲)
114	交直両用TIG溶接機	(株)ダイヘン	AVP-3000P	H13	740	黒沢(憲)
115	真空チャンバー	日本精機	φ500×H250mm(内寸)材質:SUS304	H14	280	黒沢(憲)
116	溶接部可視化装置	石川島播磨重工業(株)	ILV型	H12	110	黒沢(憲)
117	冷間等方加圧成形装置	アプライドパワージャパン(株)	CIP-50-2000	H07	310	関根
118	多目的高温炉	富士電波工業(株)	ハイマルチ5000	H08	1,040	関根
119	放電プラズマ焼結装置	住友石炭鉱業(株)	SPS-2080	H08	5,400	関根
120	高速精密切断装置	平和テクニカ(株)	S-100G II	H29	300	関根
121	超音波映像装置	日立エンジニアリング・アンド・サービス	FS200 II	H22	1,780	瀧田
122	極間式磁気探傷機	日本工機	BY-1	S43	110	黒沢(憲)
123	磁気探傷機	(株)島津製作所	PRA-80型	S46	230	黒沢(憲)
124	超音波探傷器	東京計器	SM80型	S53	510	黒沢(憲)
125	X線透過検査装置	理学電気工業(株)	300EG-B2L型	S55	1,000	黒沢(憲)
126	JSNDI仕様デジタル超音波探傷器	GEインスペクション・テクノロジーズ・ジャパン(株)	USM35X JE	H23	160	黒沢(憲)
127	3Dプリンターシステム	STRATASAS	FORTUS250mc	H25	1,120	内田(富)
128	3次元CAD/CAMシステム	CNC Software	Mastercam他	H19	1,620	小松
129	小型赤外線サーモグラフィ	(株)アピステ	FSV-210L	H30	170	小松
130	双腕型協働ロボット	(株)川田工業	Nextage	R01	810	小松
131	有限要素解析用計算システム	エムエスシーソフトウェア(株)	Marc2014AIT	H26	1,620	大竹
132	ロボットシミュレーションシステム	(株)シーエムエス	Visual Components 3D Automate	R01	730	大竹
133	協働ロボット遠隔操作システム	ユニバーサルロボット/アスラテック	UR5e/V-Sido Webconnect	R02	540	大竹
134	ロックウェル硬さ試験機	(株)アカシ	ATK-F1000	H07	190	内田(富)
135	微小硬度計	明石製作所	MVK-E型	S52	200	内田(富)
136	XY自動テーブル付硬度計	明石製作所	MS-4	S60	250	内田(富)
137	試料研磨琢磨機	ビューラー	エコメット4000	H20	720	内田(富)
138	試料研磨琢磨機	丸本工業	DAP-2	S58	720	瀬川
139	ビッカース硬度計	(株)アカシ	AVK-C2500	H04	110	黒沢(憲)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
140	電解研磨装置	ストルアス	ボレクトロール	H09	230	黒沢(憲)
141	セラミックス研磨装置	丸本ストルアス(株)	アブラミン	H10	2,670	関根
142	セラミックス自動精密切断機	丸本ストルアス(株)	アキュトム50	H11	400	関根
143	万能材料試験機	INSTRON(株)	5985	H22	2,460	黒沢(憲)
144	三次元ひずみ解析システム	(株)レーザー計測	VIC-3D	R03	2,000	黒沢(憲)
145	小型造粒機	日本アイリッヒ(株)	アイリッヒ逆流式高速混合機RVO2型	H02	200	菅原
146	ボールミル	日陶科学	架台二連式AN-3S無段変速28～100bpm	H01	110	菅原
147	中型電気炉	(株)モトヤマ	SH-3045E	H10	900	菅原
148	遊星回転ボールミル	(有)伊藤製作所	LA-PO412	H08	210	関根
149	アトライタ	日本コークス工業(株)	M1SE-X	H25	350	関根
150	真空乾燥用ミキサ	日本コークス工業(株)	FMミキサ、FM10C/I-X型	H26	910	関根
151	真空溶解炉	富士電波工業(株)	FVPM-10型	H07	1,890	内田(富)
152	ニューマブラスター	(株)不二製作所	FDQ-4S	S57	300	内田(富)
153	発光分析装置	(株)SPECTRO Analytical	SPECTROLAB M	H14	1,310	内田(富)
154	エアブラストマシン	(株)不二製作所	SGF-3 (A)	R02	500	内田(富)
155	エアブラストマシン	(株)不二製作所	SGF-3 (A)	R02	500	内田(富)
156	シャルピ衝撃試験機	(株)島津製作所	30kgm型	S54	140	内田(富)
157	万能試験機	島津製作所	UH-F300kNI	H19	700	瀧田
158	スガ摩耗試験機	スガ試験機(株)	NUS-ISO-3型	H01	170	関根
159	摩耗試験機	(株)エー・アンド・ディ	EFM-3-EM	H09	420	関根
160	ベント式射出成形機	日精樹脂工業(株)	NEX110-IV-12EG φ32ベント式可塑化ユニット	R02	1,780	野辺
161	押出機	(株)テクノベル	KZW25TW-60MG-NH(1200)スクリュ径25φ	H16	1,620	工藤(素)
162	集塵機	アマノ(株)	PIE45	H18	490	工藤(素)
163	樹脂乾燥機	アドバンテック東洋(株)	DRL823WA	H16	220	工藤(素)
164	砥粒挙動モニタ用レンズ	(株)ニコン	ML-Z07545他	H12	110	中村
165	クリーンベンチ	日本エアーテック(株)	BCM-843S-S	H16	100	久住
166	小型切削動力計	日本キスラー(株)	9256C2	H16	500	久住
167	自動研磨ヘッド	ビューラー	オートメット2000 60 - 1970	H20	110	久住
168	砥粒分散用超音波発生器	トミー精工	UD-201(S)	H13	110	久住
169	平坦度測定装置	(株)ニデック	FT-900 (ウェハ用)	H25	1,270	久住
170	磁束密度測定装置	F.W.BELL	9550	H09	130	丹
171	電界制御装置	トレック・ジャパン(株)	MODEL20/20B	H10	110	久住
172	除振台	明立精機(株)	AYA-1809K4	H21	110	久住
173	電界砥粒制御用小型片面研磨装置	ビューラー	エコメット250／オートメット250	H28	160	久住
174	電界砥粒制御用多機能ワイヤーソー	(株)タカトリ	WSD-K2	H30	1,010	久住

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
175	材料物性評価装置	ソーラトロン	1260-MAS (ソーラトロン)	H18	700	田口
176	誘電率測定用サンプルホルダー	東陽テクニカ	SH2-Z	H25	100	田口
177	動的光散乱式測定装置	(株)Malvern	ゼータナノサイザー ナノZSP	H26	810	久住
178	電源装置	トレック・ジャパン(株)	MODEL609-6	H07	190	中村
179	安全キャビネット	日本エアーテック	BHC-1006ⅡA/B3	H20	110	中村
180	蛍光顕微鏡	(株)ニコン	E400-RFL 1	H15	200	中村
181	CCDカラーカメラ	東京電子	CS5270i-S	H12	110	中村
182	サーマルサイ클ー	Bio-Rad	T100	H27	100	中村
183	プレートリーダー	Bio-Rad	iMark PCシステム	H27	100	中村
184	蛍光式光ファイバー温度計	安立計器	FL-2000	H28	100	中村
185	フローサイトメーター	ベックマン・コールター	CytoFLEX 3レーザー13カラー	H28	1,220	中村
186	核酸増幅システム	三洋電機バイオメディカ(株)	MDF-192	H17	310	大久保
187	15MHzファンクションウェーブジェネレータ	日本ヒューレット・パカード(株)	33120A	H11	110	久住
188	オシロスコープ	日本ヒューレット・パカード(株)	HP-54645A	H11	110	久住
189	研磨装置	不二越機械工業(株)	SLM-140	H22	490	久住
190	ゼータ電位測定装置	Sysmex	Nano Z	H19	340	久住
191	オシロスコープ	ソニー・テクトロニクス(株)	TDS-420A	H05	100	久住
192	片面研磨装置	不二越機械工業(株)	SLM-140改	H25	560	久住
193	熱電発電モジュール温度特性評価試験装置	サカタ理化学(株)	MS-010	H24	520	菅原
194	高転写成形用急加熱冷却金型システム	山下電気(株)	超臨界発泡射出成形機用金型	H26	1,110	野辺
195	高速引張試験機	(株)島津製作所	HITS-T10	H21	2,410	黒沢(憲)
196	落錘衝撃試験機	INSTRON(株)	9205HV	H21	1,470	黒沢(憲)
197	材料試験高速解析システム	(株)フォトリオン	FASTCAM SA-X	H24	800	黒沢(憲)
198	立形マシニングセンタ用集塵防塵装置	アマノ(株)	PIE-30SD	H22	780	加藤
199	立形マシニングセンタ	ファナック	α-T14ids	H16	470	加藤
200	複合材硬化成形用オートクレーブ	(株)羽生田鉄工所	φ850 x 1500L	H21	1,470	藤嶋
201	複合材料切断機	(株)丸東製作所	AC-300CF	H22	580	藤嶋
202	フラットベット切断機	(株)ミマキエンジニアリング	CF2-1215RC-S	H25	760	藤嶋
203	複合材料圧縮成形装置	(有)郷製作所	MBO05-GMS	H27	1,410	藤嶋
204	超臨界発泡射出成形機	日精樹脂工業(株)	NEX180Ⅲ 25E	H24	3,040	野辺
205	減圧除湿乾燥機	(株)カワタ	DV-30	H26	250	野辺
206	プリント基板加工システム	日本LPKF(株)	Protomat C100HF	H16	460	久住
207	プレジジョンパワーアナライザ	横河電機(株)	WT3000	H23	180	佐々木(大)
208	直流安定化電源	菊水電子工業(株)	PAT80-100T WITH USB	H27	180	佐々木(大)
209	電子負荷装置	菊水電子工業(株)	PLZ1004WH	H27	100	佐々木(大)
210	グローワイヤー試験機	Physics tecnics Labor	TA03.35 (付属チャンバBT-07)	H25	320	伊藤(亮)
211	雑音総合評価試験機	(株)ノイズ研究所	MODEL EMC-5000S	H01	890	佐々木(大)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
212	低温恒温高湿器	エスベック(株)	PSL-2K	H19	240	佐々木(大)
213	ファストトランジェントノバースト試験機	(株)ノイズ研究所	FNS-AX3-B50B	H26	150	佐々木(大)
214	雷サージ試験システム	(株)ノイズ研究所	LSS-15AX-C1/S	H13	110	伊藤(亮)
215	耐候性試験機	岩崎電気(株)	SUV-W161	H25	1,540	伊藤(亮)
216	静電気試験器	ノイズ研究所	ESS-S3011A	H29	200	伊藤(亮)
217	冷熱衝撃装置	エスベック(株)	TSA-73ES-W	R01	700	伊藤(亮)
218	バイポーラ電源	松定プレジジョン	POEF60-20	H27	100	丹
219	複合環境試験装置	IMV(株)	EM2502(1250/SA5M) (振動試験機本体) Syn-3HA-40 (恒温恒湿槽)	H26	1,720	伊藤(亮)
220	真空乾燥器	EYELA	VOS-450SD	H09	130	遠田
221	自動研磨装置	ビューラー	AUTOMET2&ECOMET3	H09	170	遠田
222	スクラパー付ドラフトチャンバー	オリエンタル技研(株)	GNE-1500N	H09	180	遠田
223	発熱量測定装置	(株)島津製作所	CA-4PJ	H10	110	遠田
224	粉塵ドラフト	オリエンタル技研工業(株)	GNS-1800S	H10	110	遠田
225	排ガス分析装置	(株)島津製作所	GC-17A	H10	120	遠田
226	ガスクロ用オートインジェクター	島津製作所	AOC-20i	H16	110	遠田
227	GC用熱分解装置	(株)島津製作所	PY-2020iD	H21	520	遠田
228	サイクロンサンブルミル	藤原製作所	CSM-F1	H20	110	遠田
229	ハロゲン化合物測定自動前処理装置	(株)ダイアインストルメンツ	AQF-100	H18	730	遠田
230	ビード作製装置	東京科学(株)	TK-4100型	H16	810	遠田
231	ハンディ型燃焼排ガス分析計	(株)テストー	t350システムXL	H23	130	遠田
232	放射線(α線、β線、γ線)測定器	日立アロカメディカル(株)	TCS-362,TCS-172B,ICS-323C	H23	110	遠田
233	粒度分布測定装置	日機装(株)	MT3300EX2-SDC-H	H25	580	遠田
234	赤外線サーモグラフィカメラ	日本アビオニクス(株)	R300SR-H	H26	100	遠田
235	ハロゲン化合物測定用検出器	Thermo SCIENTIFIC社	ICS-1600	H26	410	遠田
236	ガス蒸気吸着量測定装置	日本ベル(株)	BELSORP-max-12-N-VP	H26	920	遠田
237	超純水製造装置	アドバンテック東洋(株)	RFU665DA	H26	100	遠田
238	CHN元素分析装置	LECO	CHN628	R02	570	遠田
239	ガスクロマトグラフ質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	8890GC+5977B	R03	1,610	遠田
240	低温恒温恒湿器	タバイエスベック(株)	PL-3SP型	H05	180	遠田
241	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	Agilent 7500 Series ICP-MS	H18	1,680	遠田
242	イオンクロマトグラフ(陰イオン・陽イオン・糖分析システム)	ダイオネクス	ICS-3000+2100型	H22	1,570	遠田
243	吸着性能評価装置	Quantachrome社	ChemBET-3000型	H16	700	遠田
244	バイオシェーカー	タイテック(株)	BR-43FL-MR	H23	110	遠田
245	ふるい振とう器	タイテック(株)	BR-43FL-MR	H23	100	遠田
246	分子量分布測定装置	(株)島津製作所	ProminenceGPCシステム	H25	390	遠田

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
247	高感度ガスクロマトグラフ	(株)島津製作所	Tracera	H27	470	遠田
248	波長分散型蛍光X線装置	(株)リガク	ZSX Primus IV	R01	1,170	遠田
249	紫外可視分光光度計	(株)島津製作所	UV-3600i Plus	R03	420	阿部
250	微粉砕機	中央化工機(株)	MB-1	H09	110	遠田
251	粗粉砕機	三田村理研工業(株)	SR-2	H09	140	遠田
252	凍結粉砕器	日本分析工業(株)	JFC-1500型	H15	300	遠田
253	小型タンデムリング粉砕機	中央化工機商事(株)	TR-LM	H24	110	遠田
254	歯車型ロッド粉砕媒体利用振動ミル試験装置	中央化工機商事(株)	粉砕量800g,振動数800cpm—1500cpm	H25	100	遠田
255	マスクレス露光装置	ハイデルベルグ・インストルメンツ(株)	IT	R04	890	梁瀬
256	非接触三次元デジタイザー	東京貿易テクノシステム(株)	COMET	H21	1,990	内田(富)
257	電源ノイズ測定器	日本テクトロニクス(株)	MD04104-6	H23	250	佐々木(大)
258	全光束測定システム	ラブスフェア	OP-FLUX-76-CA	H23	2,410	梁瀬
259	電子スピン共鳴測定装置	ブルカー・バイオスピン社	EMXplus型 (マイクロ波ブリッジ含)	H25	1,830	菅原
260	薄膜・粉末両用型高輝度X線回折装置	(株)リガク	SmartLab9K-INP	H29	2,580	菅原
261	マイクロオージェ電子分光装置	日本電子(株)	JAMP-7830F	H14	9,270	岡田
262	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	日本電子(株)	JSM-7900F	H30	5,490	菅原
263	蛍光X線膜厚計	セイコー電子工業(株)	SEA-5120	H06	1,410	岡田
264	イオンスパッタ装置	日本電子(株)	JUC-5000	H03	2,040	岡田
265	実体顕微鏡	ケイエスオリンパス	SZH-141	H05	350	岡田
266	光電子分光装置 (ESCA)	アルバックファイ(株)	5600MC	H04	17,910	千葉
267	卓上顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	Miniscope TM3030Plus,EDX:Quantax70	H27	770	千葉
268	高感度マグネットメータ	プリンスメントメジャメント社	MicroMag2900	H05	4,510	山根
269	紫外分光式磁気特性評価装置	ネオアーク	BH-M800UV-HD-10	H17	1,410	山根
270	クリーンブースA	日本エアーテック	AER-2000C	H09	110	山根
271	ポータブル型分光測定装置	ARCCopix S.A.社	ARCSpectro FT-NIR Rocket 0.9-2.6	H26	210	山根
272	モノクロメータ式分光光源	朝日分光(株)	MAX-303+,CMS-100	H27	200	山根
273	偏光カメラ	ビットラン	スロットブレードMC1F10HP付き ,100VAC (日本国内向け)	R04	100	山根
274	ダイヤラップ研磨システム	(株)マルトー	ML-150P	H05	110	岡田
275	低速切断機	サウスベイトテクノロジー	SBT650	H05	110	岡田
276	恒温恒湿槽	ADVANTEC	AGX-224	H07	310	田口
277	純水・超純水製造装置	アドバンテック(株)	RFU655DA・RFU543RA	H22	240	田口
278	静電容量微小変位計	ナノテックス	PS-Ⅲ-5D	H16	110	小松
279	卓上プラズマエッチング装置	三友製作所	TP-50B	H27	470	伊勢
280	ハイトゲージ	ハイデンハイン(株)	CERTO-CT60M	H06	430	伊勢
281	静電式バッテリー装置	エンジニアリングシステム(株)	QDX500-V-XC	H25	1,130	伊勢
282	ダイシング・ソー	(株)ディスコ	DAD320	H07	1,470	内田(勝)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
283	摩擦摩耗試験機	ブルカー・ジャパン(株)	UMT-TL-BASE	R01	900	関根
284	スパッタ・蒸着複合装置	トッキ(株)	SPS506	H07	3,980	山根
285	パッチ式多元スパッタ装置	トッキ(株)	SPM506	H07	3,820	山根
286	スパッタ機用RFマッチングボックス	トッキ(株)	RF-MN750	H19	220	山根
287	イオンビームガン	アリオス	EMIS-212	H17	440	内田(勝)
288	スパッタリング用パルス電源	日本MKS(株)	RPG-50A-00	H17	290	内田(勝)
289	イオンミリング装置	コモンウェルス	ミラトロンIV	H04	1,940	田口
290	クライオコンプレッサー	ブルックス・ジャパン	8200空冷式	H26	100	田口
291	パッチ式多層スパッタ装置	日電アネルバ(株)	SPF-540H特	H04	2,570	伊勢
292	パッチ式スパッタ装置	日電アネルバ(株)	SPF-332H	H06	2,040	伊勢
293	ディスクスパッタ装置	日本真空技術(株)	SSH-4S	H05	12,570	山根
294	空冷インバーターチャラー	オリオン機械(株)	RKE2200B1-V-G2	H25	120	山根
295	冷却水循環装置	オリオン(株)	RKE3750B-V-G2	H28	230	山根
296	工場顕微鏡システム	(株)ニコン	MM-11U	H04	2,990	伊勢
297	MEMS対応型マスクアライナ	ズース・マイクロテック	MA6BSA	H15	1,990	伊勢
298	超音波洗浄装置	本多電子(株)	W118	H07	450	内田(勝)
299	サンプリングオシロスコープ	レクロイ・ジャパン(株)	9354TM	H07	160	黒澤(孝)
300	高速パルスジェネレータ	日本ヒューレット・パッカード(株)	HP81110A	H11	240	黒澤(孝)
301	電波暗室・EMI測定システム	東陽テクニカ	ESIB26a	H16	9,740	黒澤(孝)
302	電波暗室用センサスキャナ	(株)デバイス	DM3423AV1/0	H19	210	黒澤(孝)
303	高利得マイクロ波アンテナ	マイテック	EM-6969	H21	110	黒澤(孝)
304	自動車用直流電源インピーダンス安定化回路網	SBK社	NNBM8125	H21	110	黒澤(孝)
305	CISPR22対応電波吸収体	TDK-EPC	IS-030A	H22	110	黒澤(孝)
306	電磁シールド特性評価システム	テクノサイエンス・ジャパン	KEC法測定システム	H22	120	黒澤(孝)
307	雑音電力測定システム	(株)東陽テクニカ	MAC600A-AJ, EPS/RFP-AJ	H25	100	黒澤(孝)
308	雑音測定用疑似通信回路網	協立電子工業(株)	KNW-2208, KNW-441, およびF-51	H25	100	黒澤(孝)
309	高周波発振器	アンリツ	MG3692C	H26	150	黒澤(孝)
310	放射・伝導イミュニティ試験システム	東陽テクニカ	IEC61000-4-3, IEC61000-4-6 2008対応	H27	1,400	黒澤(孝)
311	車載機器放射イミュニティ用アンテナ	東陽テクニカ	イミュニティ試験システム	H29	200	黒澤(孝)
312	オシロスコープ	キーサイト・テクノロジー(株)	DSOX6004A	H30	140	黒澤(孝)
313	EMS用発振器	ローデ・シュワルツ	SMB100B	R01	110	黒澤(孝)
314	ミリ波帯アンブ付アンテナ	(株)テクノサイエンス・ジャパン	LB-180400Hほか	R03	100	黒澤(孝)
315	EMC試験用交流安定化電源	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000S+ES2000B×2台	H27	250	木谷
316	EMIレシーバー	R&S	ESW-26, TEPTO-DV/RE, TEPTO-DV/CE, TEPTO-DV/PE	H30	880	木谷
317	電源周波数磁界イミュニティ試験装置	(株)テクノサイエンス・ジャパン	IEC61000-4-8対応	R02	190	木谷
318	金属顕微鏡	(株)ニコン	XPF-UNR-B	H04	960	千葉

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
319	触針式表面形状測定装置	(株)アルバック	DEKTAK150	H21	250	千葉
320	超微小硬度計	日本電気(株)	MHA-400	H04	14,980	田口
321	マイクロ스코プ	(株)ハイロックス	KH-7700	H19	230	田口
322	高分解能走査型プローブ顕微鏡	ブルカー・ジャパン(株)	Dimension Icon	R02	2,000	久住
323	MTF評価装置	トライオプティクス・ジャパン(株)	Image Master HR LP	H21	550	梁瀬
324	金属顕微鏡システム	オリンパス光学工業(株)	BH3-MJL	H06	1,520	梁瀬
325	分光エリプソメータ	日本セミラボ(株)	SE2000	H28	1,130	山根
326	分光エリプソメータ用反射率測定モジュール	日本セミラボ(株)	SE-2000用	H30	440	山根
327	MTF評価装置	(株)エフケー光学研究所	MATRIX-CS	R03	670	笠松
328	ナノ加工用イオンビーム装置	SII社	SMI2050	H14	4,090	伊勢
329	クリーンブースB(H17導入)	日本エアーテック(株)	ECB02-22D5	H17	130	伊勢
330	スペクトラムアナライザ	日本ヒューレット・パッカード(株)	HP4396B	H09	930	小松
331	FFTアナライザ	横河ヒューレットパッカード(株)	HP35670A	H05	1,150	小松
332	光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1165	H05	340	小松
333	FFTサーボアナライザ	日本ヒューレット・パッカード(株)	HP35670A	H07	640	小松
334	高分解能光ファイバー式変位計	フォトンクス	ATW-01 +ATP-A20	H12	220	小松
335	高周波連続可変フィルタ(H13導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H13	110	小松
336	FFTアナライザー	アジレント・テクノロジー(株)	35670A	H17	170	小松
337	5ch 静電容量変位計	ナノテックス	PS-Ⅲ-5D	H17	110	小松
338	超高分解能光学スケール	Sony Manufacturing Systems Corporation	BH20	H18	110	小松
339	FFTアナライザー	小野測器(株)	DS-2100	H19	220	小松
340	高分解能・光学スケール	ソニーマニュファクチャリングシステムズ(株)	BH20	H20	110	小松
341	高分解能・光学スケール	ソニーマニュファクチャリングシステムズ(株)	BH25,BD96-B1400HC特	H21	120	小松
342	ファンクションジェネレータ (2ch出力)	日本テクトロニクス(株)	AFG3252	H21	110	小松
343	レーザ干渉変位計システム	(株)小野測器	LV-2100	H21	130	小松
344	除振台	明立精機(株)	MAPS-008A-G1010	H22	270	小松
345	走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	L-trace II	H24	680	小松
346	微小トルク検出器	ユニパルス	UTM II -0.05Nm	H26	100	小松
347	ピコメートル分解能非接触変位計	(株)マグネスケール	BN100	H26	100	小松
348	高分解能反射型レーザースケール	(株)マグネスケール	BF1,BD-96	H26	100	小松
349	差動型非接触振動計	(株)小野測器	LV-1800	H26	150	小松
350	デジタルオシロスコープ	キーサイト・テクノロジー(株)	DSOS104A	H29	230	小松
351	オートコリメータ	(株)ニコン	6B	H18	220	笠松
352	ヘッド観察用顕微鏡セット(ポアスコープ)	オリンパス(株)	G080- 034-090-55	H05	110	梁瀬
353	GMR評価高磁界用マグネット電源	菊水電子工業	PBX20-20	H10	110	山根

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
354	オシロスコープ	AgilentTechnologies	54622A	H12	110	黒澤(孝)
355	発振器	横河ヒューレットパッカート(株)	HP81110A	H11	240	木谷
356	クリーンブースC(H17導入)	日本エアーテック(株)	ACB-352C-特型	H07	130	木谷
357	光学顕微鏡	(株)ニコン	MM-11U	H07	590	木谷
358	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H09	440	木谷
359	ロングメモリオシロスコープ	レクロイ	LC574AL	H11	680	木谷
360	高精度スピンスタンド	協同電子システム	LS1000/500PS-ⅡK	H16	2,510	木谷
361	レーザー変位計	(株)キーエンス	LC-2400	H14	110	久住
362	2次元光検出器	ビットラン	BQ-73LN	H22	120	笠松
363	ズーム顕微鏡	ユニオン光学(株)	DZ2-SH	H09	230	笠松
364	電子負荷	(株)計測技術研究所	LN-300A-G7	H26	100	木谷
365	スペクトラムアナライザ	AgilentTechnologies	E4411B	H12	110	黒澤(孝)
366	スポットUV照射装置	東芝ライテック(株)	トスキュア250	H05	290	木谷
367	アンプ付き電流プローブ	ソニー・テクトロニクス(株)	AM503S+op05	H11	110	木谷
368	磁気抵抗測定装置	(有)ハヤマ	MRMS-10K	H20	3,770	黒澤(孝)
369	スイッチ・マトリックス	ケースレーインストルメンツ(株)	4200-UL-LS-12	H21	110	黒澤(孝)
370	GPIO直流電源装置	菊水電子(株)	PB×40-5	H05	260	木谷
371	光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1157	H05	620	小松
372	平面検出型光学スケール	Sony Manufacturing Systems Corporation	BZ	H18	110	小松
373	ロジックアナライザ	アジレント・テクノロジー(株)	16804A	H20	240	小松
374	オシロスコープ	アジレント・テクノロジー(株)	DSO7104A	H21	110	小松
375	小型旋盤	エムコ社	コンパクト8	H05	590	小松
376	立型帯鋸盤	ラクソー	VWS-55	H05	280	小松
377	レーザドップラ振動計	(株)小野測器	LV-1800	H25	140	小松
378	振動周波数分析器	(株)エヌエフ回路設計ブロック	FRA5097	H25	130	小松
379	静電力発生用高圧電源システム	松定プレシジョン	HAR-30P73.3	H27	100	小松
380	スポット溶接機	松下電器産業(株)	YG501SPF	H05	300	黒澤(孝)
381	標準電圧電流発生器	アドバンテスト	R6161	H05	230	内田(勝)
382	ハイスピードマイクロスコープ	(株)キーエンス	VW-9000	H28	400	笠松
383	摂動方式誘電率測定システム	キーコム(株)	摂動方式試料穴閉鎖形空洞共振器法極薄シート比誘電率・誘電正接(ϵ_r , $\tan\delta$)測定器システム	H18	310	千葉
384	一軸面内磁場印加マニュアルプローパー	ハイソル(株)	HMP-400SMS-Entry型	H27	350	千葉
385	液晶配向シミュレータ	シンテック(株)	LCD MASTER 3D	H18	190	梁瀬
386	ラビング装置	(株)E.H.C	MR-100	H18	270	梁瀬
387	可視光対応光スペクトラムアナライザ	横河計測	AQ6374-10-L1-D/FC/RFC	R02	340	梁瀬

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
388	ネットワーク・アナライザ・システム	アジレント・テクノロジー(株)	E8364A	H14	1,260	黒澤(孝)
389	高速スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー(株)	E4401B	H11	280	黒澤(孝)
390	UV加圧硬化装置	(株)E.H.C	MLP-320G	H19	110	梁瀬
391	アッペ屈折計	(株)アタゴ	DR-M4/1550	H21	110	梁瀬
392	照明光学系設計システム	Zemax	OpticStudio Professional版	H27	220	梁瀬
393	マルチメータ	横河ヒューレットパッカード(株)	HP3458A	H05	340	内田(勝)
394	スピンコータ	ミカサ(株)	MS-A150	H21	140	内田(勝)
395	LCRメータ	日本ヒューレット・パッカード(株)	HP4284A	H07	610	小松
396	高性能LD光源	メレスグリオ	56RCS002/HV	H21	110	梁瀬
397	色彩輝度計	コニカミノルタセンシング(株)	分光フィッティング方式 CS-200	H25	130	梁瀬
398	高速カメラ	(株)ディテクト	HAS-D3M	H25	110	笠松
399	ルビジウム周波数標準発振器	スタンフォードリサーチシステムズ	FS725	H17	110	黒澤(孝)
400	大規模データ処理用並列分散計算クラスタリングシステム	IBM	eServer325	H16	150	黒澤(孝)
401	発振器	(株)エヌエフ回路設計ブロック	WF1973	H19	110	黒澤(孝)
402	ロックインアンプ	(株)エヌエフ回路設計ブロック	LI5640	H19	110	黒澤(孝)
403	低ノイズアンプ	TSJ	MLA-00118-B01-35	H20	110	黒澤(孝)
404	高周波連続可変フィルタ(H11導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H11	180	木谷
405	デジタルオシロスコープ	LeCroy	WR6051A	H16	110	木谷
406	粘度計	ブルックフィールド	DV2TCP	H29	100	遠田
407	表面張力計	協和界面化学	DY-500	H29	170	遠田
408	純水・超純水製造装置	日本ミリポア(株)	Milli-Q Integral 10	H21	230	山根
409	偏光顕微鏡	オリンパス光学工業(株)	BS-751-P型	S62	110	梁瀬